

Ellipsometrie – Dickenmessung ultra-dünner Verunreinigungsschichten

Das Messprinzip der Laser - Ellipsometrie beruht auf der Veränderung eines elliptisch polarisierten Laserstrahls bei der Reflexion von einer beschichteten Oberfläche. Mittels dieser Methode lassen sich Verunreinigungs-Schichten auf Oberflächen bis in den Sub - Monolayer - Bereich (weniger als eine Moleküllage) nachweisen. (Dr. Riss GmbH, Ratzeburg)

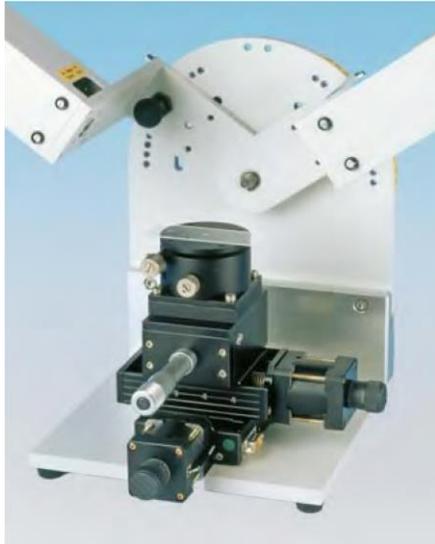


Abb. 1: Dr. Riss - Ellipsometer für die Dickenmessung extrem dünner, transparenter Verunreinigungs-Rückstände.

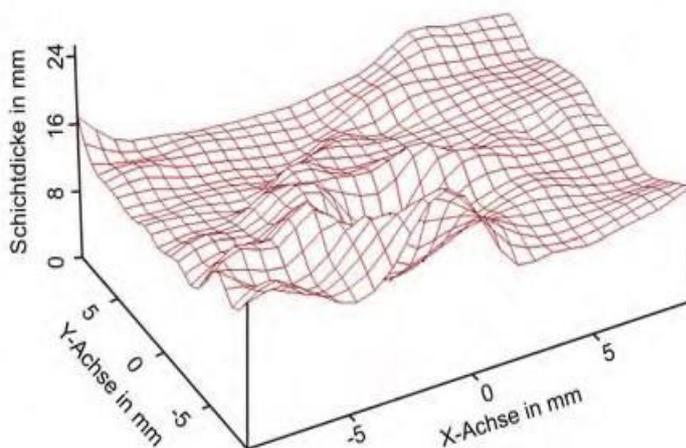


Abb. 2A: Schichtdicke vor einer Reinigungs-Prozedur mit einem Präzisions-Reinigungstuch

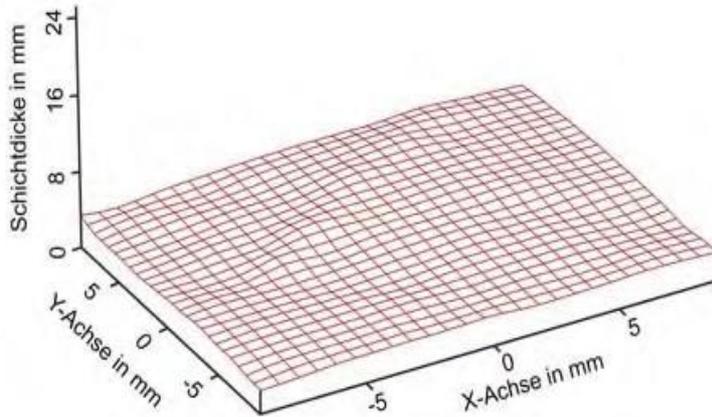


Abb. 2B: Schichtdicke nach einer Reinigungs-Prozedur mit einem Präzisions-Reinigungstuch